

- [5] D i g o n n e t M.J.R., G a e t a C.J., O'M e a -
r a D., S h a w H.J. // J. Lightwave Technol.
1987. V. 5. N 5. P. 642-646.
- [6] T i s s u e B.M., L u L., Y e n W.M. // J. Lu-
minescence. 1990. V. 45. P. 20-22.
- [7] D i e k e G.H. Spectra and energy levels of rare
earth ions in crystals. N.Y., 1968. 401 p.
- [8] К а м и н с к и й А.А. Лазерные кристаллы. М., 1975. 256 с.
- [9] К а м и н с к и й А.А. // ЖЭТФ. 1966. Т. 51. В. 1.
С. 49-58.
- [10] M c C u m b e r D.E., S t u r g e M.D. // J.
Appl. Phys. 1963. V. 34. N 6. P. 1682-1684.

Поступило в Редакцию
17 ноября 1989 г.
В окончательной редакции
17 сентября 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 22

26 ноября 1990 г.

05.4

© 1990

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ КОЛИЧЕСТВА ЖИЛ
И ИХ ЛЕГИРОВАНИЯ НА КРИТИЧЕСКИЙ ТОК
 Nb_3Sn -ПРОВОДА

Б.П. М и х а и л о в, П. К о в а ч,
П. Г у т ь к а, В.С. К р у г л о в,
Т.А. Д а в л а т ь я н

Повышение токонесущей способности многожильных Nb_3Sn проводов, приготовляемых по методу бронзовой технологии, как правило, достигается за счет увеличения количества жил ($>1000-10\,000$) [1-2]. При этом в бронзовой матрице формируются ниобиевые волокна диаметром менее 5-10 микрон, которые после термообработки большей частью превращаются в мелкозернистую Nb_3Sn -фазу. Благодаря этому у проводов с большим количеством жил обеспечиваются более высокие критические токи, чем у проводов с малым количеством толстых жил.

Однако, с другой стороны, процесс изготовления проводов с большим количеством тонких жил имеет существенные недостатки. Основной из них заключается в том, что при этом требуется проведение неоднократных последовательных сборок: сначала из стержней ниobia и бронзовой матрицы, затем из стержней композита и бронзовой матрицы. Указанное обстоятельство при каждой последующей



а



б

Рис. 1. Структура излома Nb_3Sn - слоя в 7-жильных проводах, термообработанных при $750^{\circ}C$ в течение 50 часов: а - ниобиевые жилы не легированы, б - жилы легированы цирконием 0.8 мас. %, х 3000.

сборке заметно увеличивает в проводе объемное содержание избыточной бронзы и соответственно не достигается ожидаемого повышения критического тока. Существенно осложняется процесс изготовления провода.

Тем самым вопрос оптимизации количества жил приобретает особое значение. Наиболее важным он становится в случаях, когда ниобиевые жилы легированы специальными добавками, повышающими скорость роста Nb_3Sn -слоя и одновременно задерживающими рост зерен во время диффузионной термообработки готового провода. По литературным данным [3, 4], наиболее подходящими добавками для повышения критического тока Nb_3Sn -проводов являются цирконий и титан.

В наших экспериментах, проведенных на Nb_3Sn -проводах с различным количеством жил (-1, -7 и 1615), легированных цирконием (0.8 мас. %), титаном (1.0 мас. %) и без легирующих добавок, установлены следующие основные особенности. В процессе термообработки при $750^{\circ}C$ в течение 15-75 часов на легированных цирконием жилах формируется Nb_3Sn слой с зернами на порядок более мелкими, чем на нелегированных жилах (рис. 1, а, б). При легировании титаном также заметно измельчение зерен (рис. 2, а, б). Объясняется это тем, что цирконий и титан уже при незначительных концентрациях (0.3-2.0 мас. %) в ниобии заметно измельчают зерна. Это можно наблюдать как на литых сплавах, так и после деформации литого слитка в исходные стержни композиционной заготовки. Связано это с тем, что цирконий и титан способствуют образованию в сплавах мелких выделений оксидов, препятствующих росту зерен. Указанные добавки повышают температуру рекристаллизации ниobia [5] и позволяют поднять температурные интервалы диффузии

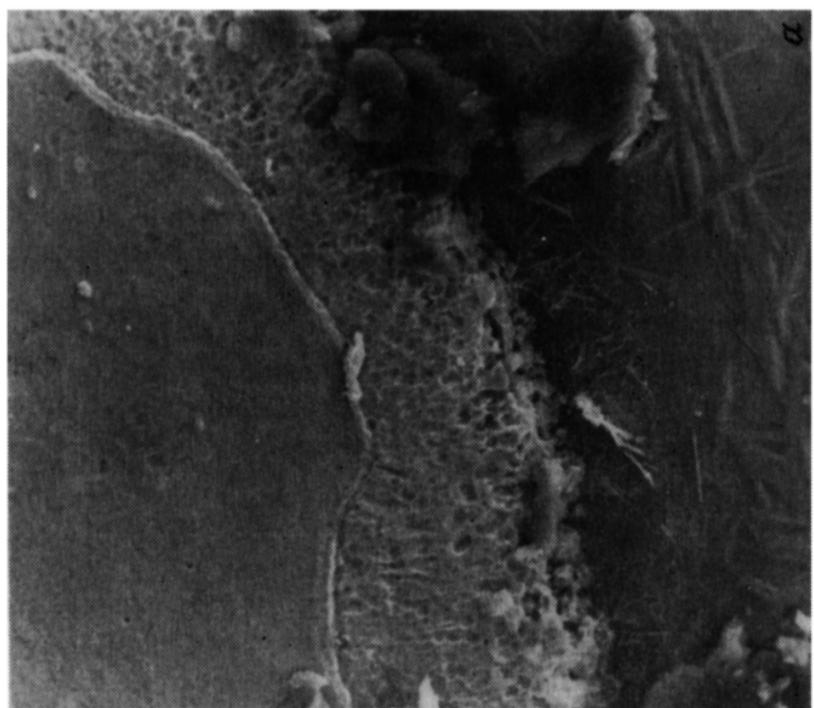
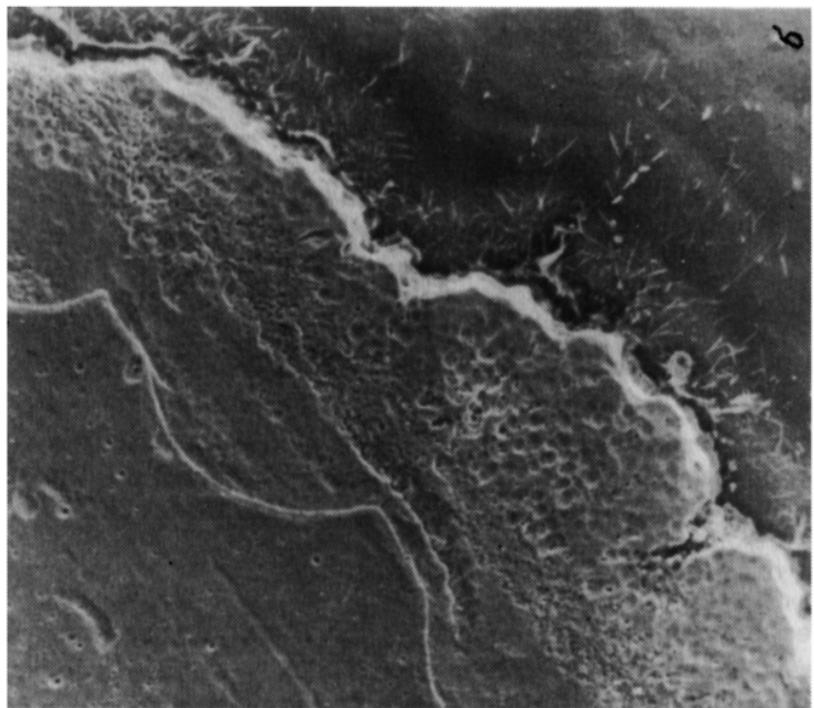
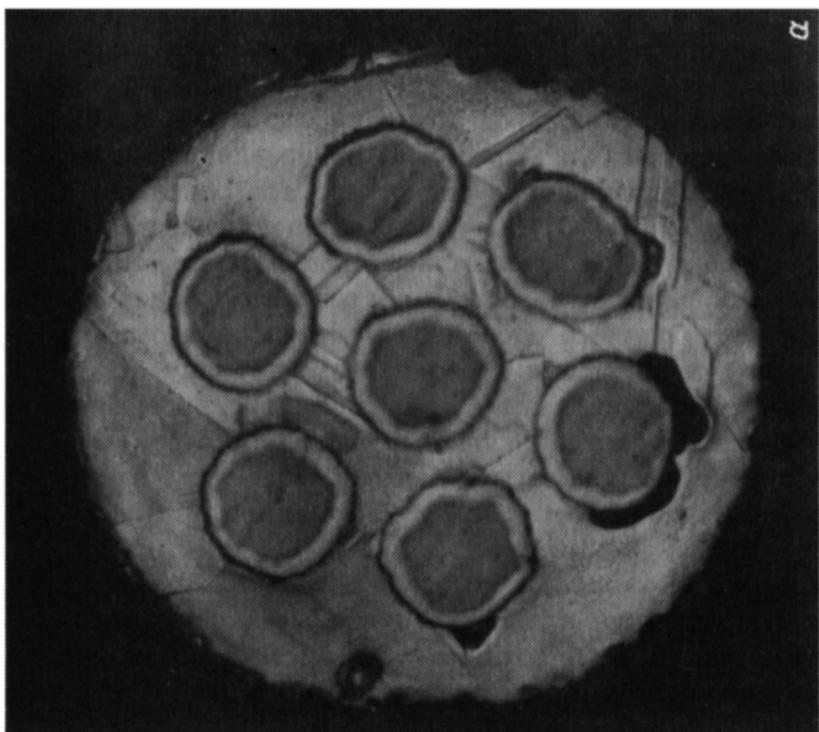
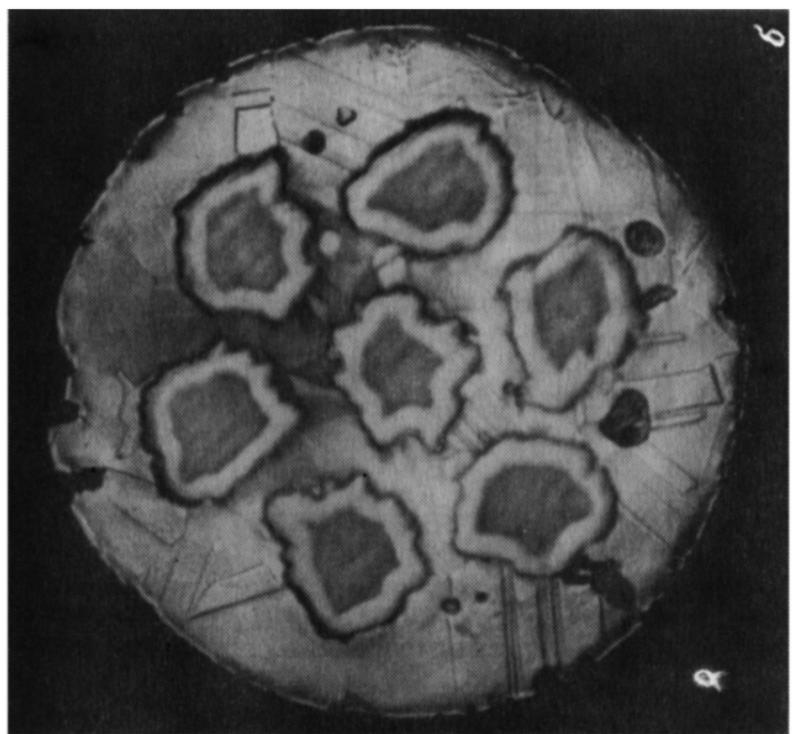


Рис. 2. Структура поперечного сечения Nb_3Sn -слоя в 1-жильных проводах, термообработанных при $750\text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение 50 часов: а - нелегированный, б - легированный, % титана, х2000.

Рис. 3. Структура поперечного сечения 7-жильных Nb_3Sn -проводов, термообработанных при 750 °С в течение 50 часов: а - ниобиевые жилы не легированы, б - ниобиевые жилы легированы цирконием 0.8 мас. %; диаметр проводов 0.4 мм.



Плотность критического тока Nb_3Sn -проводов с различным количеством легированных и нелегированных жил

Химический состав жил, мас. %	Режимы термообработки		Кол-во жил	Плотность критического тока на полное сечение провода в магнитном поле 10 Т A/cm^2
	T, $^{\circ}C$	Время, час		
Ниобий чистый	680	50	1	$1.19 \cdot 10^3$
Ниобий - 1.2 Zr	680	50	1	$1.71 \cdot 10^3$
Ниобий чистый	750	25	7	$1.9 \cdot 10^4$
Ниобий - 0.8 Zr	750	25	7	$4.92 \cdot 10^4$
Ниобий чистый	750	15	1615	$4.04 \cdot 10^4$
Ниобий - 1.0 Ti	750	15	1615	$4.49 \cdot 10^4$

онного отжига от $680-700$ $^{\circ}C$ для проводов с нелегированными жилами до 750 $^{\circ}C$ и выше для легированных цирконием и титаном проводов.

К преимуществам указанных легирующих добавок следует также отнести то, что они значительно (почти в 2 раза) ускоряют рост Nb_3Sn -слоя, тем самым относительно толстые ниобиевые жилы (50-100 микрон и более) могут быть превращены в мелкозернистую Nb_3Sn -фазу без значительного увеличения продолжительности диффузионного отжига. На рис. 3 показана структура поперечного сечения 7-жильных Nb_3Sn -проводов, легированного цирконием (0.8 мас.%) и нелегированного. Видно, что при одинаковых условиях термообработки (750 $^{\circ}C$, 50 часов) на легированных жилах слой Nb_3Sn толще. При увеличении продолжительности отжига до 100 часов эта разница в толщинах становится более заметной.

Отмеченные структурные особенности безусловно сказываются и на токонесущей способности проводов (см. таблицу).

Приведенные в таблице данные показывают более высокие значения плотности критического тока легированных цирконием и титаном проводов по сравнению с нелегированными. При этом наиболее высокая плотность критического тока у 7-жильного провода, легированного цирконием.

Таким образом, показано, что и в проводах с относительно небольшим количеством жил при легировании можно достигать плотности критического тока близкие к $10^5 A/cm^2$. Такие провода могут быть применены в магнитных системах с постоянным магнитным полем.

Результаты, представленные в работе, свидетельствуют о возможности значительного уменьшения количества ниобиевых жил в многожильном проводе за счет введения в них специальных добавок,

изменяющих кинетику роста диффузионного Nb_3Sn -слоя. Можно предполагать, что и легирование бронзовой матрицы будет оказывать подобное влияние на оптимальное количество ниобиевых жил.

Список литературы

- [1] Kruszliak J., Hutzka P., Kovacs P., Setina P. // Acta Physica Academiae Hungaricae. 1982. V. 53. N 3-4. P. 425-431.
- [2] Rupp G., Springer E., Roth S. // Cryogenics. 1977. March. P. 141-144.
- [3] Sueenaga M., Luhman T.S., Sampson W.B. // J. of Appl. Phys. 1974. V. 45. N 9. P. 4049-4053.
- [4] Sueenaga M., Tsuchijia K., Higuchi et al. // Cryogenics. 1985. V. 25. P. 123-128.
- [5] Kruszliak J., Savitsky E.M., Mikhaliov B.P. et al. Proceedings 6th International conference on magnet technology (MT-6). 1977. Bratislava. P. 1099-1104.

Поступило в Редакцию
27 июля 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 22

26 ноября 1990 г.

05.2

(C) 1990

ОДНОФАЗНЫЕ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛЕНКИ $Pb(Zr,Ti)O_3$, ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОГО РАСПЫЛЕНИЯ

С.Х. Есаян, О.В. Кандидова,
Г.А. Варданян, Л.П. Григорян,
П.Г. Петросян

Повышенный интерес к получению и исследованию сегнетоэлектрических пленок в настоящее время связан, в основном, с существенным прогрессом в создании энергонезависимых сегнетоэлектрических запоминающих устройств [1]. В результате начали бурно развиваться и совершенствоваться не только традиционные методы получения пленок (радиочастотное и магнетронное распыление), но и новые технологии, такие как *sol-gel*, *CVD*(*chemical vapor deposition*) и различные комбинированные методы